

**АННОТАЦИЯ**  
к рабочей программе дисциплины  
**Б1.В.ДВ.10.1 «ВАКУУМ-ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ»**

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Направление подготовки (специальность)</b>  | <b>28.03.02 «Наноинженерия»</b>                      |
| <b>Направленность (профиль, специализация)</b> | <b>«Инженерные нанотехнологии в приборостроении»</b> |
| <b>Квалификация (степень) выпускника:</b>      | <b>бакалавр</b>                                      |
| <b>Форма обучения</b>                          | <b>очная</b>                                         |
| <b>Срок освоения образовательной программы</b> | <b>4 года</b>                                        |
| <b>Год начала подготовки</b>                   | <b>2017</b>                                          |

**Цель изучения дисциплины:**

формирование у обучающихся знаний о свойствах, методах получения и измерения вакуума, свойствах низкотемпературной газоразрядной плазмы и особенностях применения вакуум-плазменных технологий в производстве приборов и устройств микро- и наносистемной техники.

**Задачи изучения дисциплины:**

знание свойств разреженной газовой среды и методов получения и измерения вакуума;

знание методов получения тонких металлических пленок и диэлектрических слоев в производстве изделий микро- и наносистемной техники;

приобретение навыков работы с вакуумным технологическим оборудованием.

**Перечень формируемых компетенций:**

ПКВ-2 — Готовность к применению современных технологических процессов и технологического оборудования в производстве приборов и устройств микро- и нанoeлектроники.

**Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5**

**Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен**